



KINTEK SOLUTION

Mpcvd 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착 및 실험실 다이아몬드 성장을 위한 원통형 공진기 Mpcvd 기계 시스템 반응기

품목 번호: KTWB315



소개

보석 및 반도체 산업에서 다이아몬드 보석과 필름을 성장시키는 데 사용되는 마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착 방법인 원통형 공진기 MPCVD 기계에 대해 알아보세요. 전통적인 HPHT 방법에 비해 비용 효율적인 장점을 발견하세요.

자세히 알아보기

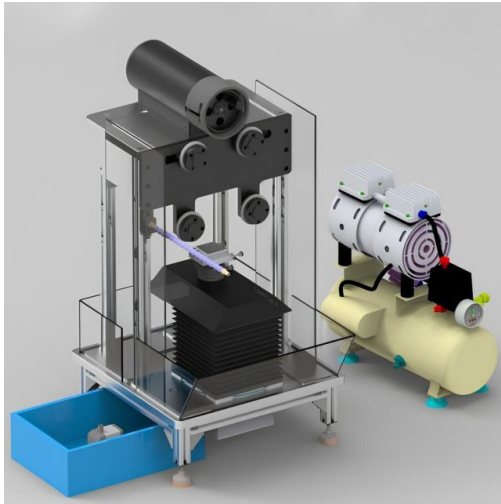
마이크로파 시스템	- 마이크로파 주파수 2450±15MHZ, - 출력 전력 1~10 KW 연속 조절 가능 - 마이크로파 출력 전력 안정성: <±1% - 마이크로파 누설 ≤2MW/cm2 - 출력 도파관 인터페이스: WR340, FD-340, 430 표준 플랜지 포함 430 - 냉각수 유량: 6-12L/min - 시스템 정재파 계수: VSWR ≤ 1.5 - 마이크로파 수동 3핀 조정기, 여기 캐비티, 고출력 로드 - 입력 전원 공급 장치: 380VAC/50Hz ± 10%, 3상
반응 챔버	- 진공 누설율 < 5 × 10-9 Pa .m3/s - 최대 압력은 0.7 Pa 미만 (Pirani 진공 게이지 표준 설정) - 압력 유지 후 12시간 동안 챔버 압력 상승은 50Pa를 초과하지 않아야 합니다. - 반응 챔버 작동 모드: TM021 또는 TM023 모드 - 캐비티 유형: 원통형 공진 캐비티, 최대 베어링 전력 10KW, 304 스테인리스 스틸 재질, 수냉식 내부 층, 고순도 석영관 밀봉 방식. - 공기 흡입 모드: 상부 환형 균일 공기 흡입 - 진공 밀봉: 메인 챔버 하단 연결부 및 주입 도어는 고무 링으로 밀봉, 진공 펌프 및 벨로우즈는 KF로 밀봉, 석영관은 금속 C-링으로 밀봉, 나머지는 CF로 밀봉 - 관찰 및 온도 측정 창: 8개의 관찰 포트 - 챔버 전면 샘플 로드 포트 0.7KPa~30KPa 압력 범위 내 안정적인 방전 (전력 압력 일치해야 함)
샘플 홀더	- 샘플 테이블 직경 ≥ 72mm, 유효 사용 면적 ≥ 66 mm - 베이스 플레이트 플랫폼 수냉 샌드위치 구조 - 샘플 홀더는 캐비티 내에서 전기적으로 균일하게 승하강 가능

가스 흐름 시스템	- 모든 금속 용접 에어 디스크 - 장비의 모든 내부 가스 회로에는 용접 또는 VCR 조인트가 사용되어야 합니다. 5개 채널 MFC 유량계, H2/CH4/O2/N/Ar. H2: 1000 sccm; CH4: 100 sccm; O2: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm - 작동 압력 0.05-0.3MPa, 정확도 ±2% - 각 채널 유량계에 대한 독립적인 공압 밸브 제어
-----------	--

냉각 시스템	• 3줄 수냉, 온도 및 유량 실시간 모니터링. • 시스템 냉각수 유량 $\leq 50\text{L/min}$ • 냉각수 압력 $< 4\text{KG}$, 입수 온도 $20\text{-}25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
온도 센서	• 외부 적외선 온도계 온도 범위 $300\text{-}1400\text{ }^{\circ}\text{C}$ • 온도 제어 정확도 $< 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 2%
제어 시스템	• Siemens smart 200 PLC 및 터치 스크린 제어 채택. • 시스템에는 다양한 프로그램이 있어 성장 온도 자동 균형, 성장 공기압의 정확한 제어, 자동 온도 상승, 자동 온도 하강 등의 기능을 실현할 수 있습니다. • 수량, 온도, 압력 등의 매개변수 모니터링을 통해 장비의 안정적인 작동 및 포괄적인 보호가 가능하며, 기능적 연동을 통해 작동의 신뢰성과 안전성을 보장합니다.
선택적 기능	• 중앙 모니터링 시스템 • 기판 베이스 전력

고정밀 다이아몬드 와이어 절단기 실험실용 톱 정밀 와이어 Edm 절단기

품목 번호: CM-1



소개

고정밀 다이아몬드 와이어 절단기는 재료 연구원을 위해 특별히 설계된 다목적의 정밀 절단 도구입니다. 연속 다이아몬드 와이어 절단 메커니즘을 사용하여 세라믹, 결정, 유리, 금속, 암석 및 기타 다양한 취성 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다.

자세히 알아보기

전원 공급 전압	220V 50Hz; 최대 전력: <100w
스핀들 속도	2rpm ~ 260rpm 범위 내에서 조절 가능
제어 시스템	① 수동 제어: Y축 및 Z축 속도 범위 1 40mm/min; ② 자동 제어: Y축 공급 길이 0.01 50mm; Z축 공급 속도 0.05mm 40mm/min 길이 0.01 50mm; Z축 공급 속도 0.05mm 40mm/min Z축 공급 길이 1 60mm; 자동 절단 빈도 1 99;
절단선 총 길이	20m
두 가이드 휠 사이의 내부 거리	95mm
Y축 이동 거리	≤ 50mm
Z축 이동 거리	≤ 60mm
2D 고정구	수평 회전 0-360°, 좌우 기울기 20°
하중판 크기	80mm× 51mm
절단 깊이	≤ 50mm 11. 최대 절단 샘플 크기: Ø 50mm × 50mm

800Mm X 800Mm 작업대를 갖춘 정밀 와이어 톱 실험실 절단기 (다이아몬드 단선 원형 소형 절단용)

품목 번호: CM-2



소개

다이아몬드 와이어 절단기는 주로 세라믹, 결정, 유리, 금속, 암석, 열전 재료, 적외선 광학 재료, 복합 재료, 생체 재료 및 기타 재료 분석 샘플의 정밀 절단에 사용됩니다. 특히 두께 0.2mm까지의 초박형 판재의 정밀 절단에 적합합니다.

자세히 알아보기

와이어 권선 드럼 모터 매개변수	AC220v 50Hz 300
선형 속도	0-8m/s
절단선 총 길이	150m
샘플 무게 (최대)	3kg
Z축 스트로크	≤ 160mm
Y축 스트로크	≤ 180mm
절단 샘플 직경 (최대)	Φ 150 mm
장력 구조	공압 장력
장력 조정 범위	0.1-0.4MPa
다이아몬드 와이어 직경	<0.45mm
크기	617x620x1500mm
무게	183kg

12인치/24인치 고정밀 자동 다이아몬드 와이어 절단기 실험실용 톱 정밀 와이어 Edm 절단기

품목 번호: CM-3



소개

고정밀 자동 다이아몬드 와이어 절단기는 전도성 및 비전도성 재료, 세라믹, 유리, 암석, 보석, 옥, 운석, 단결정 실리콘, 탄화규소, 다결정 실리콘, 내화 벽돌, 에폭시 보드 및 페라이트 본체를 포함한 광범위한 재료를 절단하는 다목적 절단 도구입니다. 특히 경도가 높고 가치가 높으며 파손되기 쉬운 다양한 취성 결정 절단에 적합합니다.

자세히 알아보기

전원 공급 장치	220V 50Hz
전력	<475W (최대)3
스핀들 모터	AC 가변 주파수 모터, 250W
Y, Z, R축 모터	정밀 스테퍼 모터
절단선 이송 속도	0-8m/s 조절 가능, 디지털 디스플레이
절단선 총 길이	≤ 150m
절단선 직경	≤ 0.45mm
Y축 이동 거리	≤ 300mm, 디지털 디스플레이
Z축 이동 거리	≤ 300mm, 디지털 디스플레이
Y 및 Z축 공급 표시 정확도	0.01mm
작업대 각도	0-360 ° 분해능 0.01 ° 디지털 디스플레이
작업대 반복 위치 결정 정확도	<0.032 °
절단 샘플 크기	Ø 300mm × 300mm (최대)

915Mhz Mpcvd 다이아몬드 장비 마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착 시스템 반응기

품목 번호: MP-CVD-101



소개

915MHz MPCVD 다이아몬드 장비 및 다결정 효과 성장, 최대 면적 8인치, 단결정 최대 효과 성장 면적 5인치. 이 장비는 주로 대형 다결정 다이아몬드 필름 생산, 장단결정 다이아몬드 성장, 고품질 그래핀의 저온 성장 및 마이크로파 플라즈마에 의한 에너지 공급이 필요한 기타 재료 성장에 사용됩니다.

자세히 알아보기

마이크로파 시스템 (선택적 전원 공급 장치에 따라)	- 작동 주파수: 915±15MHz - 출력 전력: 3-75kW 연속 조절 가능 - 냉각수 유량: 120/분 - 시스템 정재파 계수: VSWR ≤ 1.5 - 마이크로파 누출: <2mw/cm2
진공 시스템 및 반응 챔버	- 누출률 < 5×10-9Pa.m3/s - 최대 압력은 0.7Pa 미만입니다 (이 장비에는 수입 Pirani 진공 게이지가 포함되어 있습니다). - 압력 유지 후 12시간 동안 챔버의 압력 상승은 50Pa를 초과하지 않아야 합니다. - 반응 챔버 작동 모드: TM021 또는 TM023 모드 - 챔버 유형: 냉각 원통형 챔버, 최대 75KW 전력, 고순도, 스톤 링 셀을 처리할 수 있습니다. - 입구 방식: 상단 스프링클러 헤드 입구. - 관찰 온도 측정 창: 8개의 관찰 구멍이 수평으로 균등하게 분포되어 있습니다. - 샘플링 포트: 하단 리프팅 샘플링 포트
샘플 홀더 시스템	샘플 스테이지 직경 ≥ 200mm, 단결정 유효 사용 면적 ≥ 130mm, 다결정 유효 사용 면적 ≥ 200mm. 기판 플랫폼 수냉식 샌드위치 구조, 수직 직선 상하 이동.
가스 시스템	- 전체 금속 용접 가스 플레이트 5-7 가스 라인 - 장비의 모든 내부 공기 회로는 용접 또는 VCR 커넥터를 사용합니다.
시스템 냉각	3방향 수냉, 온도 및 유량 실시간 모니터링. - 시스템 냉각수 유량 120L/min, 냉각수 압력 < 4KG, 입수 온도 20-25.
온도 측정 방법	외부 적외선 온도계, 온도 범위 300-1400 M

일련 번호	모델 이름	비고
----------	-------	----

1	마이크로파 전원 공급 장치	표준 국내 마그네트론: Yingjie Electric / Distinguish 전원 공급 장치 국내 솔리드 스테이트 소스: Watson (+30,000) 수입 마그네트론: MKS/ pastoral (+100,000)
2	도파관, 삼핀, 모드 변환기, 상부 공진기	자체 제작
3	진공 반응 챔버 (상부 챔버, 하부 챔버, 커넥터)	자체 제작
4	적외선 온도계, 광학 변위 부품, 브래킷	적외선 온도계, 광학 변위 부품, Fuji Gold Siemens + Schneider 브래킷
5	수냉식 테이블 모션 부품 (실린더, 공작물 등)	
6	세라믹 박막 진공 게이지, Pirani 진공 게이지	Inficon
7	진공 밸브 부품 (초고진공 게이트 밸브, 정밀 공압 밸브*2, 전자기 진공 충전 차압 밸브)	Fujikin + Zhongke + Himat
8	진공 펌프 및 연결 파이프 피팅, 터, KF25 벨로우즈*2, 어댑터	펌프: Flyover 16L
9	금속 마이크로파 셀링 링*2; 금속 진공 셀링 링*1; 석영판	석영: Shanghai Feilihua 반도체 등급 고순도 석영
10	순환수 부품 (조인트, 분배 블록, 유량 감지기)	일본 SMC/CKD
11	공압 부품 (CKD 필터, Airtac 다방향 솔레노이드 밸브, 파이프 피팅 및 어댑터)	
12	가스 커넥터, EP 가스 파이프, VCR 커넥터, 필터 0.0023μm *1, 필터 10μm*2	Fujikin
13	기계 케이싱, 스테인리스 스틸 테이블, 범용 휠, 발, 브래킷 고정 나사 등	맞춤 가공
14	가스 유량계*6 (압력 제어 1개 포함)	표준 7성, 선택 사항 Fuji Gold (+34,000) / Alicat (42,000)
15	가스 플레이트 가공 (5방향 가스, 필터*5, 공압 밸브*5, 수동 밸브*6, 배관 용접)	Fuji Gold
16	PLC 자동 제어	Siemens + Schneider
17	물리브덴 테이블	

실험실 및 다이아몬드 성장을 위한 마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착 Mpcvd 기계 시스템 반응기

품목 번호: KTMP315



소개

실험실 및 다이아몬드 성장을 위해 설계된 벨 자 복명기 MPCVD 기계로 고품질 다이아몬드 필름을 얻으십시오. 탄소 가스와 플라즈마를 사용하여 다이아몬드를 성장시키는 마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착이 어떻게 작동하는지 알아보십시오.

자세히 알아보기

마이크로파 시스템	- 마이크로파 주파수 2450±15MHZ, - 출력 전력 1~10 KW 연속 조절 가능 - 마이크로파 출력 전력 안정성: <±1% - 마이크로파 누설 ≤2MW/cm2 - 출력 도파관 인터페이스: WR340, 430 (FD-340, 430 표준 플랜지 포함) - 냉각수 유량: 6-12L/min - 시스템 정재파 계수: VSWR ≤ 1.5 - 마이크로파 수동 3핀 조정기, 여기 캐비티, 고출력 로드 - 입력 전원: 380VAC/50Hz ± 10%, 삼상
반응 챔버	- 진공 누설율 < 5 × 10-9 Pa .m3/s - 최대 압력은 0.7 Pa 미만 (피라니 진공 게이지 표준 장착) - 압력 유지 12시간 후 챔버 압력 상승은 50Pa를 초과하지 않아야 합니다. - 반응 챔버 작동 모드: TM021 또는 TM023 모드 - 캐비티 유형: 나비 공진 캐비티, 최대 베어링 전력 10KW, 304 스테인리스 스틸 재질, 수냉식 이중층, 고순도 석영판 밀봉 방식. - 공기 흡입 모드: 상부 환형 균일 공기 흡입 - 진공 밀봉: 주 챔버 하단 연결부 및 주입 도어는 고무 링으로 밀봉, 진공 펌프 및 벨로우즈는 KF로 밀봉, 석영판은 금속 C-링으로 밀봉, 나머지는 CF로 밀봉 - 관찰 및 온도 측정 창: 4개의 관찰 포트 - 챔버 전면 샘플 로딩 포트 0.7KPa~30KPa 압력 범위 내 안정적인 방전 (전력 압력 일치해야 함)
샘플 홀더	- 샘플 테이블 직경 ≥70mm, 유효 사용 면적 ≥64 mm - 베이스 플레이트 플랫폼 수냉식 샌드위치 구조 - 샘플 홀더는 캐비티 내에서 전기적으로 균일하게 승하강 가능

가스 흐름 시스템	- 모든 금속 용접 에어 디스크 - 장비의 모든 내부 가스 회로에는 용접 또는 VCR 조인트 사용. 5채널 MFC 유량계, H2/CH4/O2/N/Ar. H2: 1000 sccm ; CH4: 100 sccm; O2: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm - 작동 압력 0.05-0.3MPa, 정확도 ±2% - 각 채널 유량계의 독립 공압 밸브 제어
-----------	--

냉각 시스템	• 3 라인 수냉, 온도 및 유량 실시간 모니터링. • 시스템 냉각수 유량 $\leq 50\text{L/min}$ • 냉각수 압력 $< 4\text{KG}$, 입수 온도 $20\text{-}25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
온도 센서	• 외부 적외선 온도계 온도 범위 $300\text{-}1400\text{ }^{\circ}\text{C}$ • 온도 제어 정확도 $< 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 2%
제어 시스템	• Siemens smart 200 PLC 및 터치 스크린 제어 채택. • 다양한 프로그램을 갖춘 시스템으로 성장 온도 자동 균형, 성장 공기 압력 정확한 제어, 자동 온도 상승, 자동 온도 하강 등의 기능 구현 가능. • 유량, 온도, 압력 등의 파라미터 모니터링을 통해 장비의 안정적인 작동 및 포괄적인 보호가 가능하며, 기능적 연동을 통해 작동의 신뢰성과 안전성을 보장합니다.
선택 기능	• 중앙 모니터링 시스템 • 기판 베이스 전력

인발 다이 나노 다이아몬드 코팅용 Hfcvd 장비 시스템

품목 번호: MP-CVD-100



소개

나노 다이아몬드 복합 코팅 인발 다이는 초경합금(WC-Co)을 기판으로 사용하며, 화학 기상 증착법(CVD법)을 이용하여 금형 내측 구멍 표면에 일반 다이아몬드 및 나노 다이아몬드 복합 코팅을 합니다.

자세히 알아보기

HFCVD 기술 구성		
기술 매개변수	장비 구성	시스템 구성
벨 자: 직경 500mm, 높이 550mm, SUS304 스테인리스 스틸 챔버; 내부 스테인리스 스틸 스킨 단열, 리프팅 높이 350mm;	진공 챔버(벨 자) 본체 1세트(자켓형 수냉 구조)	진공 챔버(벨 자) 본체; 공동은 고품질 304 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 수직 벨 자: 자켓형 수냉 자켓이 벨 자 전체 외부에 설치됩니다. 벨 자의 내부 벽은 스테인리스 스틸 스킨으로 단열되어 있으며, 벨 자는 측면에 고정됩니다. 정확하고 안정적인 위치 지정; 관찰 창: 진공 챔버 중간에 수평으로 배치된 200mm 관찰 창, 수냉, 배플, 측면 및 상단 구성 45도 경사 각도, 50도 관찰 창 (수평 관찰 창 및 샘플 지지대와 동일한 지점 관찰); 두 개의 관찰 창은 기존 위치와 크기를 유지합니다. 벨 자 하단은 벨 자 평면보다 20mm 높으며, 냉각 장치가 설치됩니다. 대형 벨브, 배기 벨브, 공기 압력 측정, 바이패스 벨브 등 평면에 예약된 구멍은 금속 메쉬로 밀봉되어 전극 인터페이스 설치를 위해 예약됩니다.
장비 테이블: L1550* W900*H1100mm	드래그 샘플 테이블 장치 1세트(듀얼 축 구동 방식)	샘플 홀더 장치: 스테인리스 스틸 샘플 홀더(용접 수냉) 6구 장치; 개별적으로 조정 가능하며, 상하 조정만 가능하고, 상하 조정 범위는 25mm이며, 좌우 흔들림은 상하 이동 시 3% 미만이어야 합니다(즉, 1mm 상승 또는 하강 시 좌우 흔들림은 0.03mm 미만). 샘플 스테이지는 상승 또는 하강 시 회전하지 않습니다.
최고 진공도: 2.0×10 ⁻¹ Pa ;	진공 시스템 1세트	진공 시스템: 진공 시스템 구성: 기계식 펌프 + 진공 밸브 + 물리적 블리드 밸브 + 메인 배기 파이프 + 바이패스; (진공 펌프 공급업체 제공), 진공 밸브는 공급 밸브 사용; 진공 시스템 측정: 막 압력.
압력 상승 속도 : ≤5Pa/h;	2채널 질량 유량계 가스 공급 시스템	가스 공급 시스템: 질량 유량계는 B사가 구성하며, 양방향 공기 흡입, 유량은 질량 유량계로 제어되며, 양방향 합류 후 상단에서 진공 챔버로 유입되며, 공기 흡입 파이프 내부는 50mm입니다.
샘플 테이블 이동: 상하 범위 ± 25m; 상하 이동 시 좌우 흔들림 비율 ± 3% 요구됨;	전극 장치 1세트(2채널)	전극 장치: 4개의 전극 구멍의 길이 방향은 지지대 플랫폼의 길이 방향과 평행하며, 길이 방향은 200mm 직경의 메인 관찰 창을 향합니다.
작동 압력: 막 게이지 압력계 사용, 측정 범위: 0 ~ 10kPa; 1kPa ~ 5kPa에서 일정하게 작동하며, 일정 압력 값은 ± 0.1kPa 변동합니다.	냉각수 시스템 1세트	냉각수 시스템: 벨 자, 전극, 하부 플레이트 모두 순환 수냉 파이프라인이 장착되어 있으며, 물 흐름 부족 경보 장치 3.7: 제어 시스템이 장착되어 있습니다. 벨 자 리프팅, 배기, 진공 펌프, 메인 라인, 바이패스, 경보, 흐름, 공기 압력 등의 스위치, 계측기, 계측기 및 전원 공급 장치는 스탠드 측면에 설정되어 있으며, 14인치 터치 스크린으로 제어됩니다. 장비는 수동 개입 없이 완전 자동 제어 프로그램을 갖추고 있으며 데이터를 저장하고 호출할 수 있습니다.
공기 흡입 위치: 벨 자 상단에서 공기 흡입, 배기 포트 위치는 샘플 홀더 바로 아래에 위치합니다.	제어 시스템	냉각수 시스템: 벨 자, 전극, 하부 플레이트 모두 순환 수냉 파이프라인이 장착되어 있으며, 물 흐름 부족 경보 장치 3.7: 제어 시스템이 장착되어 있습니다. 벨 자 리프팅, 배기, 진공 펌프, 메인 라인, 바이패스, 경보, 흐름, 공기 압력 등의 스위치, 계측기, 계측기 및 전원 공급 장치는 스탠드 측면에 설정되어 있으며, 14인치 터치 스크린으로 제어됩니다. 장비는 수동 개입 없이 완전 자동 제어 프로그램을 갖추고 있으며 데이터를 저장하고 호출할 수 있습니다.
제어 시스템: PLC 컨트롤러 + 10인치 터치 스크린	자동 압력 제어 시스템 1세트(독일산 오리지널 압력 제어 밸브)	냉각수 시스템: 벨 자, 전극, 하부 플레이트 모두 순환 수냉 파이프라인이 장착되어 있으며, 물 흐름 부족 경보 장치 3.7: 제어 시스템이 장착되어 있습니다. 벨 자 리프팅, 배기, 진공 펌프, 메인 라인, 바이패스, 경보, 흐름, 공기 압력 등의 스위치, 계측기, 계측기 및 전원 공급 장치는 스탠드 측면에 설정되어 있으며, 14인치 터치 스크린으로 제어됩니다. 장비는 수동 개입 없이 완전 자동 제어 프로그램을 갖추고 있으며 데이터를 저장하고 호출할 수 있습니다.

인플레이션 시스템: 2채널 질량 유량계, 유량 범위: 0-2000sccm 및 0-200sccm; 공압 밸브	저항 진공 게이지	냉각수 시스템: 벨 자, 전극, 하부 플레이트 모두 순환 수냉 파이프라인이 장착되어 있으며, 물 흐름 부족 경보 장치 3.7: 제어 시스템이 장착되어 있습니다. 벨 자 리프팅, 배기, 진공 펌프, 메인 라인, 바이패스, 경보, 흐름, 공기 압력 등의 스위치, 계측기, 계측기 및 전원 공급 장치는 스탠드 측면에 설정되어 있으며, 14인치 터치 스크린으로 제어됩니다. 장비는 수동 개입 없이 완전 자동 제어 프로그램을 갖추고 있으며 데이터를 저장하고 호출할 수 있습니다.
3.1.10 진공 펌프: D16C 진공 펌프	저항 진공 게이지	냉각수 시스템: 벨 자, 전극, 하부 플레이트 모두 순환 수냉 파이프라인이 장착되어 있으며, 물 흐름 부족 경보 장치 3.7: 제어 시스템이 장착되어 있습니다. 벨 자 리프팅, 배기, 진공 펌프, 메인 라인, 바이패스, 경보, 흐름, 공기 압력 등의 스위치, 계측기, 계측기 및 전원 공급 장치는 스탠드 측면에 설정되어 있으며, 14인치 터치 스크린으로 제어됩니다. 장비는 수동 개입 없이 완전 자동 제어 프로그램을 갖추고 있으며 데이터를 저장하고 호출할 수 있습니다.

전통적인 인발 다이와 나노 다이아몬드 코팅 인발 다이 비교표

기술 지표	전통적인 인발 다이	나노 다이아몬드 코팅 인발 다이
코팅 표면 입자 크기	없음	20~80nm
코팅 다이아몬드 함량	없음	≥99%
다이아몬드 코팅 두께	없음	10 ~ 15mm
표면 거칠기	Ra≤0.1mm	A급: Ra≤0.1mm B급: Ra≤0.05mm
코팅 인발 다이 내측 구멍 직경 범위	Φ3 ~ Φ70mm	Φ3 ~ Φ70mm
수명	수명은 작업 조건에 따라 다름	6-10배 더 길
표면 마찰 계수	0.8	0.1



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

